

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЭМС-ФОРУМ 2013

25-26 июня 2013 года в Санкт-Петербурге состоится 3-й международный МЭМС-форум "МЭМС-датчики и малогабаритные системы. Сферы применения". Принять в нем участие приглашаются специалисты предприятий и организаций, работающие в сфере разработки, производства или применения (интеграции) микроэлектромеханических систем, менеджеры и эксперты в области МЭМС, а также ученые, представляющие российские научные организации и образовательные учреждения.

Конференция пройдет на базе ведущего российского предприятия в области высокоточной навигации, гироскопии и морской радиосвязи – ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор". Организаторы мероприятия – "Русская Ассоциация МЭМС" в сотрудничестве с ООО "Совтест АТЕ" (Россия), ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" (Россия), Coventor Inc.(США). Информационная поддержка – европейская Ассоциация предприятий электронной и микросистемной индустрии Silicon Saxony e.V. (Германия).

Сегодня МЭМС-форум – это единственное в России мероприятие, посвященное исключительно вопросам разработки, производства и применения датчиков, основанных на микроэлектромеханических системах, и перспективам развития российского рынка МЭМС.

Работа конференции будет проходить по направлениям:

- перспективы применения МЭМС-устройств в медицине и автомобильной промышленности;
- новейшие материалы в производстве МЭМС;
- оптические сенсорные решения;

- микроэлектромеханические системы для жестких условий промышленной эксплуатации и авиакосмической промышленности;
- беспроводные и проводные сенсорные решения, основанные на МЭМС;
- инерциальные МЭМС-системы;
- системная интеграция.

В рамках форума состоится заседание круглого стола "Перспективы развития рынка МЭМС в России", на котором планируется обсуждение следующих вопросов: перспективы локализации внутри страны всей производственной цепочки МЭМС; прогнозы развития рынка на 2013-2015 годы; определение эффективного пути развития российского направления МЭМС, получения доступа к передовым технологиям; роль сотрудничества с зарубежными компаниями; проблемы и трудности участников направления МЭМС в России и др.

Ожидается, что в конференции примут участие более 100 делегатов из ведущих институтов и предприятий Бельгии, Франции, Германии, США, Белоруссии, Украины и, конечно, России.

Рабочий язык конференции – русский. Предусмотрен последовательный перевод с английского на русский.

По всем вопросам просим обращаться к Болдовой Олеге Игоревне, главному специалисту по развитию "Русской Ассоциации МЭМС":

тел: +7-4712-73-11-13,
olesya.boldova@mems-russia.ru
www.mems-russia.ru

На конференции будут представлены доклады:

- МЭМС в микро- и нанoeлектронном научном центре IMEC для промышленности, медицины и профилактики здоровья, к.т.н., В.Леонов, IMEC, Бельгия.
- Тенденции применения МЭМС в автомобильной промышленности, К.Фитаман, Yole Development, Франция.
- Результаты проектирования датчиков давления с учетом перспектив развития САУ и диагностики в двигателестроении, Р.С.Коновалов, ОАО "ЭОКБ "Сигнал" им. А.И.Глухарева", Россия.
- Технологии изготовления новых материалов для нового поколения МЭМС, Д-р М.Роса, Applied Materials, США.
- Обзор оптических сенсоров по сферам их применения, Д-р М.Шилгализ, First Sensor AG, Германия.
- Технологическая платформа для изготовления МЭМС-сканеров для спектрометра лазерной камеры и других применений в IPMS, Д-р. М.Мюллер, Fraunhofer Institute IPMS, Германия.
- Влияние медленно изменяющихся условий функционирования микроэлектромеханических гироскопов на динамические и точностные характеристики датчиков, И.В.Меркурьев, д.т.н., проф. НИУ "МЭИ".
- Фотокамеры для модулей, применяемых в жестких условиях окружающей среды, дипл.инж. В.П. фон Хессен, Silicon Micro Sensors GmbH, Германия.
- Капсулированный микроэлектромеханический акселерометр с обратной связью, М.В.Федоров, к.т.н., ОАО "ГИРООПТИКА", Россия.
- Сенсорные решения для измерения радиации, давления и ускорения, Д-р В.Цэйтмайр, First Sensor AG, Германия.
- Проблема энергосбережения в беспроводных сенсорных системах, Д.Парси, VeonAir, Франция.
- Интерферометры Фабри-Перо нового поколения, Д-р Н.Нойман, Infratech GmbH, Германия
- Магниторезистивные МЭМС-сенсоры и перспективы их развития. Технология 3D-сборки интегральных микросхем, Г.Д.Демин, ЗАО "Зеленоградский нанотехнологический центр", Россия.